BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-037693

(43)Date of publication of application: 07.02.1992

(51)Int.CI.

C30B 29/04

(21)Application number: 02-139811

(71)Applicant: IDEMITSU PETROCHEM CO LTD

(22)Date of filing:

31.05.1990

(72)Inventor: HOSOYA IKUO

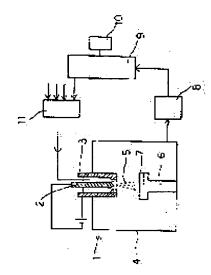
ISOZAKI TOSHIO

(54) METHOD FOR SYNTHESIZING DIAMOND

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the damage of electrodes and to reduce cost by using a gaseous mixture of CO with H2 or H2 with inert gas as gaseous starting material.

CONSTITUTION: Gaseous starting material prepd. by mixing CO with H2 or H2 with inert gas in 0.01-5 ratio of CO to H2 is fed into the gap between cathode 2 and anode 3 through a flow rate controller 11, converted into hot plasma by DC arc discharge and spouted as a plasma jet 5. This jet 5 is collided against a substrate 7 on a substrate holder 6 and rapidly cooled to grow diamond on the substrate 7.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平4-37693

Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月7日

C 30 B 29/04

C 7158-4C R 7158-4G

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

❷発明の名称

ダイヤモンドの合成方法

②特 願 平2-139811

雄

❷出 願 平2(1990)5月31日

@発明者 細谷

千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1660番地 出光石油化学株式会

补内

⑩発明者 磯崎

敏 夫

郁

千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1660番地 出光石油化学株式会

社内

勿出 願 人

出光石油化学株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

四代 理 人 弁理士 渡辺 喜平

明 組 書

1. 発明の名称

ダイヤモンドの合成方法

2. 特許請求の範囲

(1) アーク放電によって原料ガスを熱ブラズマ 化し、ブラズマジェットとして喰出させ、 危 後 後 に な が イヤモンドを成長させるとともに、 反応 袋 は 排出されるガスを回収し、 循環させて再び 原料ガスとして利用するダイヤモンドの合成方法 にい な 、 原料ガスとして一酸化 皮素と、 水素 ある いは 水素と不活性ガスとの配合ガスを用いたことを特 後とするダイヤモンドの合成方法。

(2) 請求項1 記載のダイヤモンドの合成方法において、一酸化炭素/水素=0.01~ 5であることを特徴とするダイヤモンドの合成方法。

(3) 請求項1または2記載のダイヤモンドの 合成方法において、カソードの周辺にアルゴンガ スを施すことを特徴とするダイヤモンドの合成方 法

3 . 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明はダイヤモンドの合成方法に関し、特に、反応後に排出されるガスを再び原料ガスとして利用するダイヤモンドの合成方法に関する。 【従来の技術】

近年、ダイヤモンドの合成技術は著しい発展を遂げ、種々の合成方法が開発されている。

このうち、ダイヤモンドを高速で合成する方法としては、DCアーク放電により発生させた無プラズマをブラズマジェットとして基板に衝突させ、熱プラズマを急冷させて基板上にダイヤモンドを成長させる方法がある。

しかし、この方法は高速でダイヤモンドを合成できる反面、原料ガス(ブラズマガスおよび反応ガス)を多量に稍要するという欠点がある。 このうち、反応に寄与しないガスであるアルゴンガスは、水素などに比べ高価であり、ダイヤモンド合成時におけるコストの半分近くを占めてしまうという問題がある。

また、反応検に排出されるガスはほとんど未反

応であり、反応に寄与しないアルゴンガスはもち

ろんのこと、反応ガスであるメタンガスや水素ガ
ス等も未反応のまま、すなわち反応に使用できる
状態で排出されてしまうため、収率が極めて悪い
という問題がある。

上記問題を解決する技術として、反応後に排出されるガスを回収し、値渡させて再び原料ガスとして用いることにより、原料ガスにかかる費用の低減を図る技術が提案されている(特開平1-164795号)。

「発明が解決しようとする課題]

しかしながら、反応後に排出されるガスを回収 し、循環させて再び原料ガスとして再利用する 従来の技術においては、反応ガス(炭素板ガス) として皮化水素(アルコールなども含む)を用い ているため、メタン等の皮化水素とカソード(陰 種)が反応し、カソードが容融してしまい、 長時 間運転することができないという問題がある。

また、プラズマが安定しないため、得られる

合成に要すコストの大幅な低減化を可能ならし めたダイヤモンドの合成方法の提供を目的とす x

[課題を解決するための手段]

上記目的を達成するために、本発明者等は、ダイヤモンド合成における原料ガスと排気ガスの関係について銀産研究を行なった結果本発明を完成した。

ダイヤモンドの品質が安定しないという問題があ ス

上記カソードの容融およびプラズマの不図を解析する技術として、第5図とににはないます。電極と反応しないアルゴンと、電極とほどにない水素とで放電を起させ、放電を起びで、放って流から原料となるメタン等の皮化水素を図るで、で電極の保護およびプラズマの安定化を図る技術が知られている(特隅平1-179789号)。

しかし、かかる技術を上述した原料ガスの再利用を図る技術に適用しようとすると、反応後に排出されるガスの中からメタン等の皮化水素を分離しなければならず、コストがかかりすぎて、排出ガスを再利用する意味がなくなってしまうという問題がある。

本発明は上述した問題点にかんがみてなされた もので、 長時間重転しても電優の損傷を起すこと がなく、 しかも反応後の排出ガスの再利用を容易 に図れるようにすることによって、ダイヤモンド

以下、本発明を、図面を参照しながら具体的に 歴明する。

第1図は本発明のダイヤモンドの合成方法を実 施するための装置の一例を示す模式図である。

図面において、1は直茂(DC)プラズマを担 木体であり、カソード(勝極) 2、 アノードは腸 極) 3 および真空反応容器 4 等で構成されれ(例 る。カソード 2 は無電子放射性能の良い材料(例 えば、W-Th等)で形成されている。アノード 3 の お卸性能の良い材料(例えば、CU等)で形成まれ ている。カソード 2 およびアノード 3 の形状状 でいる。カソード 2 およびアノード 3 の形状状の ないる。また、電極には冷却水

なお、第2図に示すようにカソードの周辺に純粋なArガスを若干税し、シース(さや)を形成すると長時間運転してもカソードが劣化しないので

電極間に印加される直流の電圧(アーク電圧)および電流(アーク電流)値は、理論的には削限

されないが、現実的な範囲としては、電圧10~ 200 V、電流30~ 200 0 A の範囲、特に電圧70~ 120 V、電流50~ 500 Aの範囲とするのが好ましい。

本発明においては、原料ガスとして一酸化炭素(CO)と、水素(Ha)あるいは水素(Ha)とアルゴン(Ar)などの不活性ガスとの混合ガスが用いられる。

水素ガスが存在すれば、ダイヤモンド合成が可能であるが、水素ガスのみの場合は、電極の特託が激しい。したがって、水素およびアルゴンガスの双方を用いることが好ましい。

一酸化炭素は、炭素額ガスとして必須のものである。一酸化炭素の悪合割合は特に制限されないが、結晶性の良いダイヤモンドを得るためには、CO/H。= 0.01~ 5、好ましくは 0.5~2 の範囲とする。また、CO/H。が0.01より小さいと基板上に生成したダイヤモンドがエッチングにより除去されてしまうのでダイヤモンドを合成することができなかったり、生成速度が低く好ましくない。さらに、CO/H。>>5 だと基板にグラファイトが析出

空到達圧力が10-*Torrであれば、約三本分のトーチに使用することができる。ポンプ8は排気側にオイルが混入するのを助ぐためドライポンプ等のオイルフリータイプのポンプを使用するのが好ましい。

バッファタンク9の材質、容量、充填圧等は、特に制限されないが、一例を示せば、SUS104製の容量 500gのタンクで充填圧 1~2kg/cm²・G である。バッファタンク9には、タンク中のガス組成製定用のセンサ10が取付けられており、バッファタンク内の圧力、組成を常時監視できるようになっている。

バッファタンク9内に回収された排出ガスは、 疣量コントローラ11へ供給される。 疣量コント ローラ11は、 第3回に示すように、 バルブ12 を有し、 その一側には Ar供給 替13、 Ha供給 管 14、 CO供給 管15が配管され、 バルブ12の 他 の一個には バッファタンクからの排出ガス供給 管 16が配管されている。

また、各供給管13~16にはマスフローメー

してしまう.

好ましい原料ガスの組成の一例を示せば、 Ar: Ha: CO = 20:2: 2.0~0.2 である。

反応後、真空反応容器4内に排出されたガスは、ポンプ8によってバッファタンク9に回収される。真空反応容器4内の圧力は 0.1~0.5 ata となるようにポンプ8によって排気される。ポンプ8の排気能力が15002/minであり、所望する真

タ17〜20がそれぞれ取付けられている。マスフローメータ20は原料ガスのガス組成で較正してある配合ガス(Ar.Hz,CO)用のものが使用される。Ar供給管13、Ha供給管14、CO供給管15の他端はそれぞれガスボンベ(図示せず)に接続されている。バルブ12の残りの一個は、ブラズマトーチに接続された原料ガス供給管21に接続されている。

次に、上記装置の運転、すなわち、本発明のダ イヤモンドの合成手順について説明する。

まず、反応開始時は、Ar,Ha,COの各ポンベから 供給される原料ガスを用いてダイヤモンド合成を 行ない、排出ガスをバッファタンク内に充填す

バッファタンク内の圧力が 2 kg/cm²・G 程度に達したところで、バルブを Ar, Ha, COガス 側からバッファタンク 側へ切換え、排出 ガスを循環させて ダイヤモンド 合成を行なう。 バッファタンク内のガス組成は、 常時一定となるよう不足したガスを補充するか、あるいは、 数時間単位 毎に不足したガ

スを補充するようにする。これは、単位時間当りのガスの制度量およびガス組成の変化が小さく、 またガス組成の多少の変化はダイヤモンド合成に 影響を与えないためである。

上記ダイヤモンド合成に伴ない原料ガス中で 商豊されるのは一酸化炭素中の炭素原子のみであ るが、グラファイトやダイヤモンド状カーボン (DLC: Diamondo Like Cabon)等の顧生成物が 1%程度生成し、さらに循環中に生ずるリークに よっても原料ガスが商豊されるので、COの他、Ar およびHaについても補充が必要である。

[実施例]

以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。

実施例1

第1図に示すダイヤモンド合成装置を用い、 アーク電圧 50V、アーク電流 120Aとし、各ガスの 茂畳をAr 20 2 / ain、Ha 2 2 / ain、CO 12 / ainとし て圧力 200Torrで装置の運転を開始した。30分後 にバッファタンク内の圧力が1.5kg/cm²・G を越え

この結果、約1.5gの良質なダイヤモンド酸が得られた。

実施例3

実施例1において COの 流量を 1.62 / minとした 以外は、実施例1に準じて約0.7gのダイヤモンド を得た。得られたダイヤモンドのラマンスペクト ルの額定結果を第4 図に示す。

実施例 4

実施例 1 においてアーク電圧 80V 、アーク電流 120A、各ガスの流量をH₂ 20 g/min、CO 32 /min とした以外は、実施例 1 に準じて約 0.3 gのダイヤ キンドを得た。

比較例

炭素製ガスとしてCOの代わりにCH。を用い、各ガスの流量をCH。1 g/min、H。15 g/min、Ar 10g/min とした以外は実施例1と何様にして運転を行なった。

この結果、プラズマトーチにおける放電が不安 定であり、カソードが溶融し、ダイヤモンドの合 成はできなかった。 また、ガス組成の分析を行なったところ、 Ar のリーク量 20 2 / hr 、 H₂のリーク量 22 / hr 、 CO の消費量 12 / hr であることが判った。

上記合成の結果、約0.48のダイヤモンドが得られた。皮素額ガス (CC) に対するトータル転化率を求めたところ約 15%であった。得られたダイヤモンドのラマンスペクトルの測定結果を終4 図に示す。

<u> 実施例 2</u>

実施例 1 で求めた Ar と Hi の リーク 量 および CO の 稍要量と同量のガスをボンベから補給 しつつ 2.4 時間 直続運転を行なった以外は、実施例 1 と同様にしてダイヤモンドの合成を行なった。

なお、Arガスはカソードシースのためカソード 周辺に直接供給するようにした。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明のダイヤモンドの 合成方法によれば、原料ガスとしてCOと、 Haある いはHaとArとの混合ガスを用いているので、 長時 間差転しても電極の損傷を起すことがない。

また、 反応核の排出ガスの再利用を図ることが できるので、 ダイヤモンド合成にかかる 費用の大 幅な低減を図ることができる。

さらに、 廃棄されるガスの量が少なくて狭むの で環境汚染の問題も生じにくい。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明のダイヤモンドの合成方法を関連するための設置の一例を示す検式図、第2 図回じくカソードの周辺にArガスを放す状態を検えている。第3 図は何じく校量コントローラを示すを文で、第4 図は本発明によって得られたダイヤモンド合成装置の部分所面図である。

1:直旋プラズマ装置 2:カソード

特開平4-37693 (5)

3:アノード

4 : 真空反応容器

6: 茶板ホルダー

7:基板

8: ボンブ

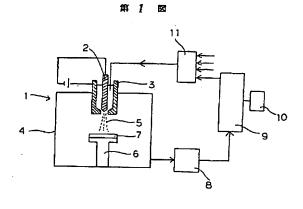
9:バッファタンク

10:センサ

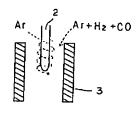
11: 液量コントローラ

出願人 出光石抽化学株式会社

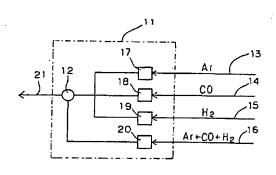
代理人 弁理士 渡辺 喜平



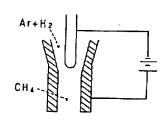
第 2 図



第3図



第 5 図



1333 ラマンシフト (cm - ')

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.